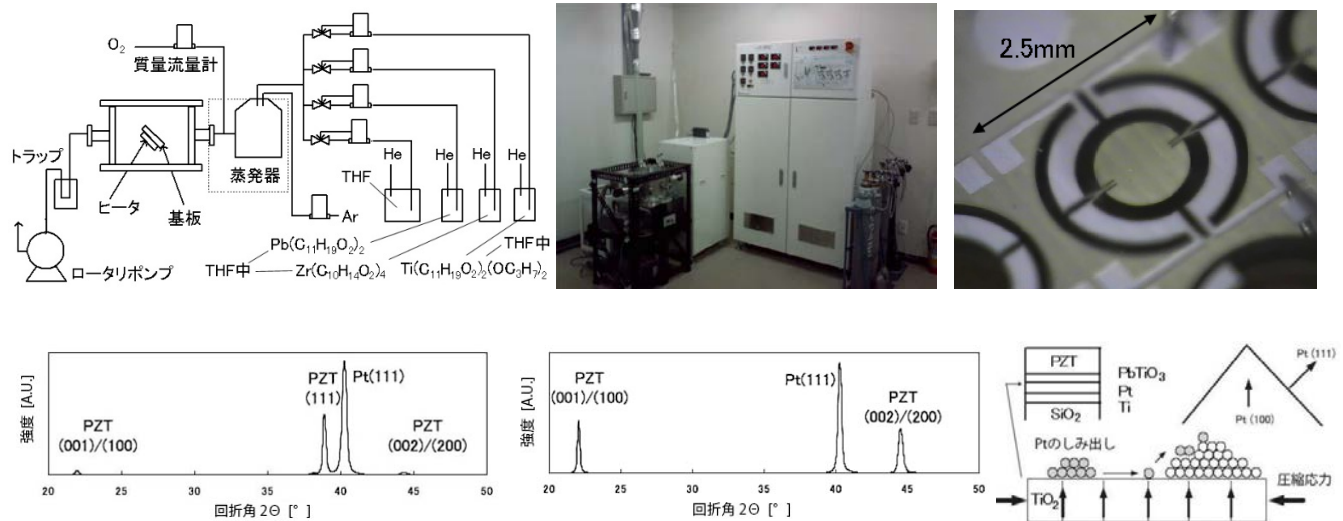
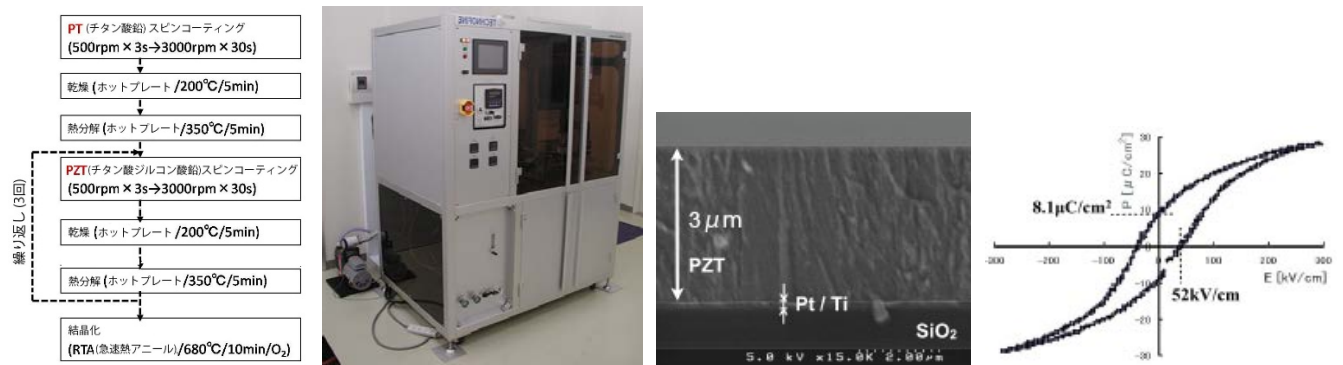


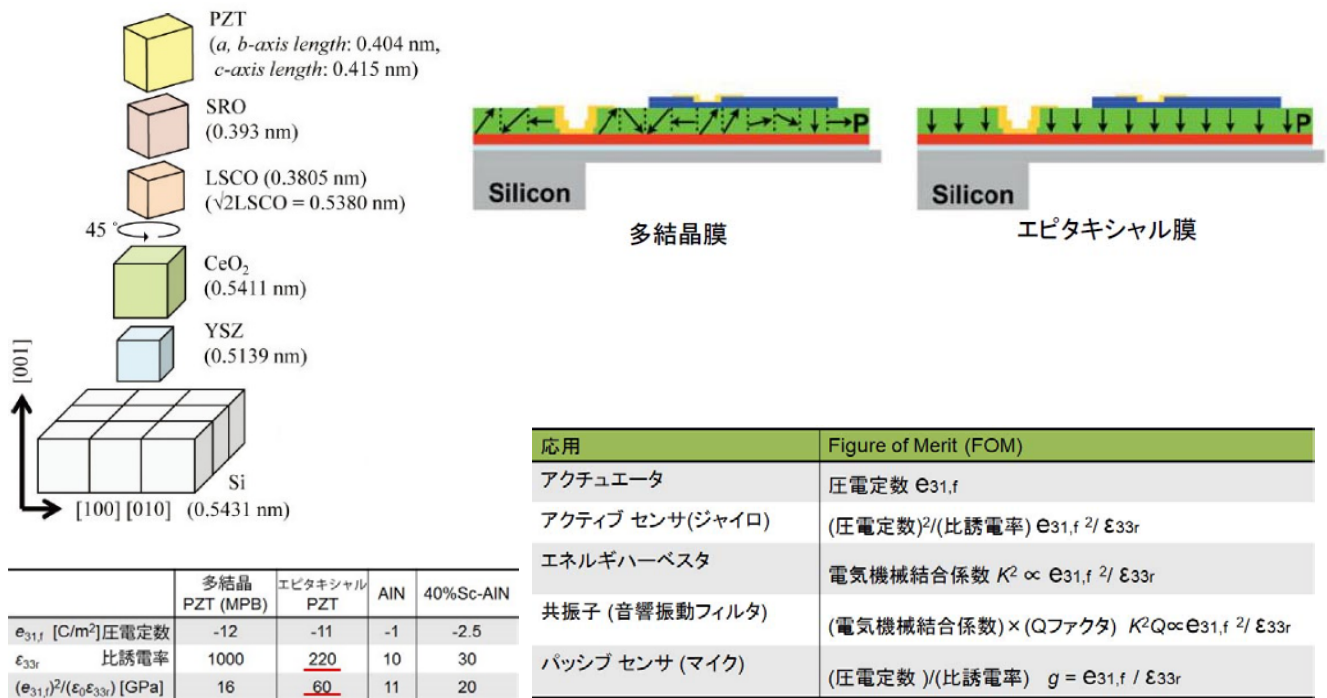
7 MEMS 用 PZT 薄膜



MOCVD による PZT 薄膜 (H.Matsuo, Y.Kawai, S.Tanaka and M.Esashi, Jap. J. Appl. Phys, 49 (2010) 061503)



ゾルゲル法による PZT 薄膜 (Y.Kawai, N.Moriwaki, M.Esashi and T.Ono, Proc. of the 27th Sensor Symp. (2010) 21)



スパッタ法によるバッファ層付エピタキシャル PZT 薄膜 (S.Yoshida, et al., IEEE Trans. on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control, 61, 9 (2014) 1552)